

研究タイトル:

精密・微細加エシステムに関する教育・研究

氏名: 角田陽/KAKUTA Akira E-mail: kakuta%tokyo-ct.ac.jp (%を@に置換して下さい)

職名: 准教授 学位: 博士(工学)

所属学会・協会: 日本機械学会,精密工学会,応用物理学会

キーワード: 精密加工システム工学, 微細加工システム工学

・精密加工システム工学全般

技術相談・微細加工システム工学全般 提供可能技術:・生産システム工学全般

研究内容: 精密加工システム工学, 微細加工システム工学

高精度かつ微細なシステム全般の設計、形状創成、運用などに関わる諸問題について、問題解決のために、加工法や生産システムの開発、改良、保守等の教育や研究を行っている.

例えば、エッチングや真空蒸着を応用した従来は実現困難な形状や表面テクスチャ構造を作製する手法の開発や微小部品の整列装置の開発などを行っている.

また、微細加工機械要素の応用として、培養細胞の培養方向の伸長方向制御を微細形状によって行うことを実用化するなどの応用といった教育や研究も行っている.

提供可能な設備・機器:

名称・型番(メーカー)	
ドライエッチング装置	金属微分干涉顕微鏡
エピタキシャル真空蒸着装置	原子間力顕微鏡
高真空蒸着装置	
イオンシャワー装置	
露光装置	